

表 6

配 方	PS-26	PS-29	PS-77	PS-79
向列相温度范围(℃)	-5—+45	-15—+61	0—+52	-18—+66
盒厚(微米)	12.4	12.4	11.6	15.4
测试温度(℃)	19	20	20	20
τ_{NC} (毫秒)	15	10	15	5
τ_{rp} (秒)	5	4.5	6	3.5
电阻率(欧姆·厘米)	3.5×10^9	2×10^{10}	—	5×10^9
阈值电压 V_{th} (伏)	25	20	30	25
存贮对比度	8:1	6~7:1	5~6:1	6:1
扫描对比度	>25:1	17:1	>10:1	16:1
τ_s	>数周	>数周	>数周	>数周

入时间约为 10 毫秒,每页的写入时间为 320 毫秒,每页的擦除时间为 200 毫秒,故整个一页显示所需时间为 520 毫秒,可得较快的显示速度.

五、在 10^6 位激光全息存储计算模型中的应用¹⁾

我们所研制的液晶组页器可与全息光路系统相容,进行全息写入操作,并能与全息透镜的蝇眼阵列和光电接收阵列对接. 通过电光偏折器全息光路联试,经调制后的全息图象,图形清晰,杂散光小,反差好. 32×32 组页器从记录的一子阵重构象测其信号“1”与“0”之光强比(相对值)为 20:1~40:1(4880 埃). 取重铬酸盐明胶干板记录组页器的全息像,令其中一子阵全息重构象与光电接收阵列相配有光码转为

电码效果,可以区别他们的 1/0 码.

六、结 束 语

用相变液晶制成的数字组页器可以高速写入及存贮模型,并能得到好的反差比. 进行激光全息光路系统联试结果,证明液晶组页器能起到将存入数据进行空间编码并调制物光的作用.

参 考 文 献

- [1] 加藤嘉则·小暮 攻,電子材料,11-14(1975),28—33.
- [2] 斎藤富士郎·谷 千束等, テレビジョン学会技術報告,昭和 53 年 11 月 17 日.

1) 该部分工作与中国科学院计算技术研究所协作进行.

非晶态硒薄膜的光电导性*

吴道怀 陈菊芳 阮嗣桂

(中国科学院上海硅酸盐研究所)

一、引 言

非晶态硒具有良好的光电导特性,已在静电复印和彩色电视摄象中得到广泛的应用^[1-3]. 随着应用的发展,对其光电导性亦提出了更高

的要求,目前多采用硒合金来改进其光电导性的^[4,4,5].

鉴于非晶态硒基材料的组份对其载流子传输特性具有很大影响,且直接影响其光电导

* 1980 年 1 月 12 日收到.

性^[1,4-8]. 本文针对非晶态硒基材料的应用, 研究了硒砷薄膜中砷含量对其暗电阻率、光电导灵敏度、光谱灵敏度和光电流与光强关系的影响. 实验结果表明, 薄膜中砷含量对非晶态硒砷薄膜的光电导性具有重要影响.

二、原理和方法

光电导灵敏度的各种特性, 是通过测定一定尺寸样品的暗电阻率及其在不同波长、不同光强下电阻率的变化计算而得.

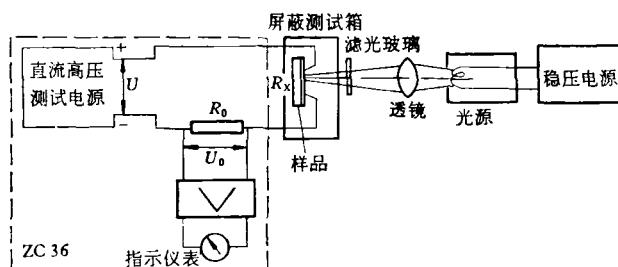


图 1 测试装置原理图

光电导灵敏度测试装置如图 1 所示. 本工作采用 ZC36 型超高电阻微电流测试仪, 测定硒砷薄膜的暗电阻和各种光照下的亮电阻. 光源用仪器灯, 经透镜聚焦于被测样品上. 光强通过不同厚度的中性滤光玻璃来改变, 用 LW-1 型激光功率计测定之. 各种波长的单色光是通过干涉滤光玻璃得到的. 测试时, 样品置于用硅胶干燥的屏蔽箱内, 以防止干扰.

三、样品制备

高纯度的硒和砷按设计配比称入抽真空的石英安瓿内, 在转式炉中熔融 24 小时生成硒砷合金. 再用真空镀膜法制成薄膜, 用石英晶体振荡器控制蒸发速率与薄膜厚度.

用 X 射线荧光分析测定蒸发薄膜的组份, 本文中所用组份均以此为准.

测试样品采用平面型结构. 以红宝石为衬底, 蒸发金作接触电极. 样品厚度为 1—2 微米.

四、实验结果与讨论

1. 暗电阻率与组份的关系

各种组份硒砷薄膜的暗电阻率的测量结果示于图 2. 实验结果表明, 非晶态硒砷薄膜的暗电阻率, 随着砷含量增加而单调下降. 纯硒的暗电阻率接近 10^{13} 欧·厘米, 而 $\text{Se}_{56}\text{As}_{44}$ 的暗电阻率约 3×10^{11} 欧·厘米.

这一结果与 J. M. Mackowski 等人^[6] 所报道的结果定性一致. 他们认为非晶态硒中含有 Se_8 环和长链两种结构, 而砷元素的加入打开了 Se_8 环结构, 构成了“分支连接”(branching junction), 从而有助于电阻率的降低.

2. 光电导灵敏度与组份的关系

光电导灵敏度定义为在恒定光照下, 光照前后电导率之差 $\Delta\sigma$ 与光照前的暗电导率 σ 之比 $\Delta\sigma/\sigma$. 测量在恒定光照下进行, 光强为 2 毫瓦/毫米². 电场强度约 6×10^3 伏/厘米.

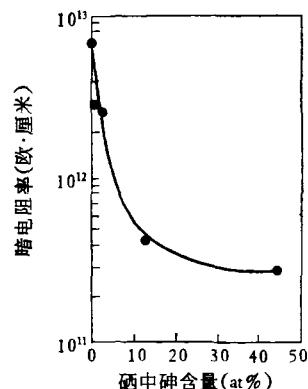


图 2 硒砷薄膜的暗电阻率与组份的关系

实验结果示于图 3. 非晶态硒砷薄膜的光电导灵敏度在纯硒时最高, 在低砷浓度区随砷含量增加很快下降, 在砷含量为 10—15 at% 时达到最低点, 以后又缓慢上升. 这一结果与用硒砷薄膜做静电复印时, 其感度与硒中砷含量的关系相一致^[1].

非晶态硒砷薄膜在低砷浓度下, 灵敏度

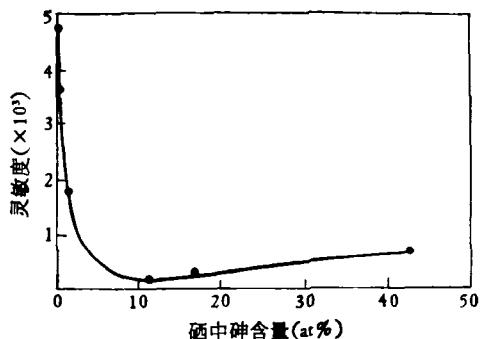


图3 硒砷薄膜的光电导灵敏度与组份的关系

$\Delta\sigma/\sigma$ 随砷元素的增加而下降,这是由两个原因引起的:一是上节所述暗电阻率随砷含量增加而减小(即暗电导率 σ 增大);二是由于载流子传输特性变化。J. Schottmiller 等人^[7,8]的研究指出,非晶态硒是由 Se_8 环和长链两种结构组成的,砷的加入扰乱了非晶态硒的环-链平衡,引起 Se_8 环总数减少和“分支连接”增加。而电子传输是与 Se_8 环相联系的,砷的加入引起电子漂移迁移率 μ_e 指数下降。又“分支连接”形成空穴陷阱,使空穴寿命 τ_p 和漂移迁移率 μ_p 下降。其结果是附加电导率 $\Delta\sigma$ 下降 ($\because \Delta\sigma = \Delta n e \mu = e \alpha \beta I \mu \tau$)。这样,随着砷元素的增加, σ 增大而 $\Delta\sigma$ 减小,致使灵敏度 $\Delta\sigma/\sigma$ 下降。

3. 光谱灵敏度与组份的关系

对不同组份的硒砷薄膜,进行了光谱灵敏度测试。实验结果示于图4。图中曲线为归一化的等能量曲线。

由实验结果可见,纯硒的全色性很差,在红光波段几乎不感光。随着硒中砷含量的增加,光谱灵敏度变宽并移向长波, $Se_{56}As_{44}$ 的全色性较好。

4. 光电流与光强的关系

光电流随光照强度而变化的函数关系,是探索光电导机理的重要依据。本文对各种组份的硒砷薄膜,测量了光电流与光强的关系(见图5),得出如下规律:

(1) 在测量范围内(光照强度一直到2毫瓦/毫米²),未见光电流有饱和趋势。

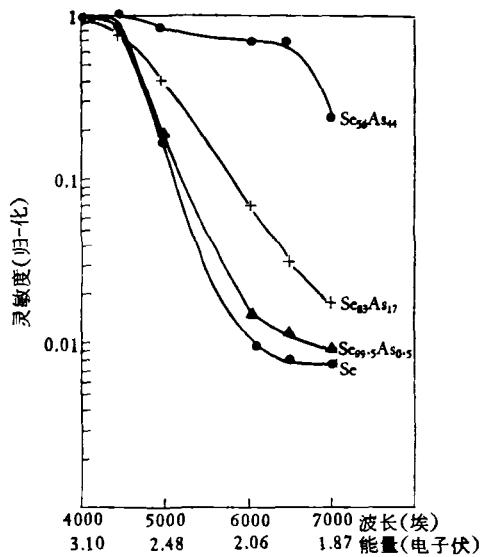


图4 硒砷薄膜的光谱灵敏度

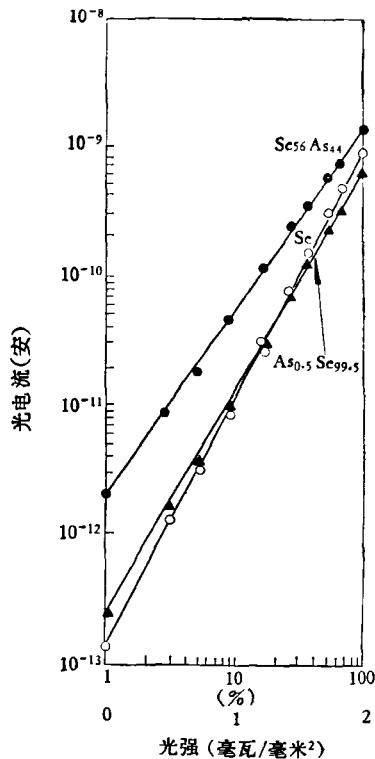


图5 硒砷薄膜的光电流与光强的关系

(2) 光电流 J_{ph} 与光强 I 的关系,可以用 $J_{ph} \propto I^n$ 来描述。

(3) 指数 $n > 1$, 随薄膜组份而不同,且随砷含量的增加而减小。

这种 $n > 1$ 的超线性光电导,说明非晶态

硒砷薄膜中有载流子陷阱在起作用。至于非晶态硒砷薄膜的光电导机理的深入探讨，尚待进一步研究阐明。

参 考 文 献

- [1] U. S. P., 3,312,548.
- [2] G. Abowitz, L. B. Leder, *J. Vac. Sci. Technol.*, 15-5 (1978), 1746.
- [3] N. Goto, Y. Isozaki, K. Shidara, T. Fujita, *IEEE Transactions on E. D.*, ED-21-11 (1974), 662.
- [4] G. Pfister, A. R. Melnyk, M. E. Scharfe, *Solid State Commun.*, 21-9 (1977), 907.
- [5] W. J. Hillegas, J. H. Neyhart, *J. Non-Cryst. Solids*, 27 (1978), 347.
- [6] J. M. Mackowski, J. J. Samuel, P. Kumurdjian, *J. Non-Cryst. Solids*, 15 (1974), 279.
- [7] J. Schottmiller, M. Tabak, G. Ilcovsky, A. Ward, *J. Non-Cryst. Solids*, 4 (1970), 80.
- [8] J. Schottmiller, *J. Vac. Sci. Techno.*, 12-4 (1975), 807.

不 敏 感 谐 振 腔*

方 洪 烈

(中国科学院上海光学精密机械研究所)

固体激光工作物质的光泵热形变将引起激光谐振腔特性的变化。由于此变化是一个动态过程，它将加宽激光束的积分角分布。实验工作表明^[1]不同的谐振腔受到的影响不同。我们打算从理论上探求一下不受影响的谐振腔——不敏感腔——所应具备的条件。

一、不敏感条件的建立

不敏感腔的模应该不因热形变而变化，即应满足 $du/df = 0$ ，其中 u 是模场分布， f 是工作物质热形变后等效于一个薄透镜时的焦距。由腔的衍射理论不难得出，不敏感腔应具备如下条件：

$$\frac{dK}{df} = 0, \quad (1)$$

其中 K 是腔积分本征方程的积分核。

对于任意多元件腔来说，它的积分核是^[2]

$$\begin{aligned} & \frac{ik \exp(-ikL_0)}{2\pi\sqrt{BB'}} \exp \left\{ -i \frac{k}{2B} (Cx^2 + Ax'^2 \right. \\ & - 2xx') - i \frac{k}{2B'} (C'y^2 + A'y'^2 - 2yy') \\ & \left. - ik(S - S') \right\}, \quad (2) \end{aligned}$$

其中 A, B, C, φ 等(符号与文献[3]同)是光线在腔内传播一个周期的传播矩阵 $T = \begin{pmatrix} A & B \\ \varphi & C \end{pmatrix}$ 的元素。传播矩阵 T 与变换矩阵 D (见文献[3]) 有如下关系， $T = R^{-1}D$ ，其中 R^{-1} 是参考反射面的反射逆矩阵。对于一个二维情况来说，通常有

$$S = -\frac{x^2}{2r}; \quad S' = \frac{x'^2}{2r},$$

其中 r 是镜面的曲率半径。

下面我们指出：矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad T = \begin{pmatrix} A & B \\ -\varphi & C \end{pmatrix}$$

是自伴矩阵^[4]。由此可得 $A = C$ 。如果令

$$G = C - \frac{B}{r} = A - \frac{B}{r}, \quad (3)$$

可求得

$$G = \frac{1}{2} Sp(D), \quad (4)$$

其中 Sp 表示求迹。于是我们得到不敏感条件是

$$\frac{dB}{df} = 0, \quad \frac{dG}{df} = 0. \quad (5)$$

上式中 $dB/df = 0$ ，只影响有效费涅耳数

* 1979年4月16日收到。